



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

低温气相宏量生长高质量、平直碳纳米管的方法及装置

文献类型: 专利

作者 侯鹏翔、刘畅、成会明、石超、丛洪涛

发表日期 2016-01-13

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 侯鹏翔、刘畅、成会明、石超、丛洪涛

中文摘要 低温气相宏量生长高质量、平直碳纳米管的方法及装置

公开日期 2016-01-13

申请日期 2014-04-09

语种 中文

专利申请号 201410140855.4

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78694>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 侯鹏翔、刘畅、成会明、石超、丛洪涛. 低温气相宏量生长高质量、平直碳纳米管的方法及装置. 2016-01-13. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
26	0	0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。